VBLのクリーンルーム利用者講習会(装置利用方法と防災設備)



ディープテック・シリアルイノベーションセンター ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー



2025年6月6日

◆VBL装置について

- ■VBL内の支援装置
- 1. マテリアル先端リサーチインフラ支援装置 (Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology in Japan: ARIM) -ARIM No.
- 2. VBL支援装置 VBL No.
- 3. DII支援装置(VBL装置予約ページにはない)
- 4. 予約なしで利用可能な装置
- ■装置の利用形態
- 1. 利用者講習会受講者のみ,使用可能な装置
- ⇒装置利用講習会には教員と一緒に参加
- 2. 比較的自由に利用できる装置
- 3. 運用責任者の許可を得て使う装置 (DII装置、黒川研の装置)



◆利用申請の流れ

装置の利用が可能か装置運用責任者に確認

装置の利用許可の時は材料の情報、目的を明確に



利用申請書の提出(支援装置によって申請書が違う)

ARIM利用申請書(ARIM事務局)

https://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/index.html

• DII装置

https://es.tech.nagoya-u.ac.jp/public/php/mkgKikiSearchTop.php

• VBL利用申請書(VBL事務室)

office@vbl.nagoya-u.ac.jp

• 入退管理シート(研究室でまとめて提出)



利用申請書承認



<u>利用者講習会を受講</u> (クリーンルーム利用者講習会は年-



VBL内の装置紹介

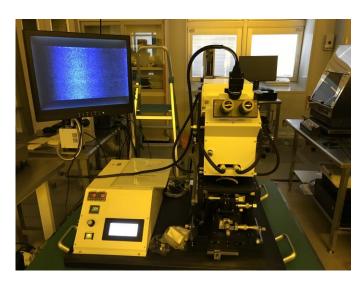
◆露光装置



フォトリソグラフィー(4インチ用)



レーザーリソグラフィー、講習会あり



フォトリソグラフィー(6インチ用)



マスクレス露光装置

◆加工装置



ICPエッチング装置

- 使用ガス:Cl2、O2、N2、Ar
- 試料サイズ:3インチ



段差計(Detak)



ICPエッチング装置

- 使用ガス: Cl2、 BCl3、 O2
- 試料サイズ:2インチx 4枚



段差計(ET200A)



RIEエッチング装置

- ・使用ガス: CF4、SF6、 Ar、O2
- シリコン系エッチング
- ・ 試料サイズ:8インチ

◆堆積装置



原子層堆積 (ALD)

- 基板サイズ: 212 mmΦ
- 薄膜形成(SiO2,Al2O3)



プラズマCVD (PECVD)

• 形成膜: SiO2

◆金属蒸着装置

Au、Ni、Cr、Alなど金属蒸着が可



電子ビーム蒸着装置(EB)



高真空電子線ビーム蒸着装置:蒸発面に対して基板が±90°回転するので傾斜蒸着が可能



超高真空蒸着装置・講習会あり



卓上型ランプ加熱装置

アニールプロセスとして利用

• 使用ガス: O₂, N₂

・試料サイズ:最大2インチ

• 最高温度1200℃

▶評価装置







高分解能走查型電子顕微鏡 電界放出型走查電子顕微鏡

(S5200) 講習会あり

試料サイズ:5mm×5mm

• EDS観察可能

(S4300)

• 試料サイズ:4インチ

卓上走查電子顕微鏡

大試料サイズ: \$\phi 80mm/

高さ50mm

• EDS観察可能



カーボン蒸着装置



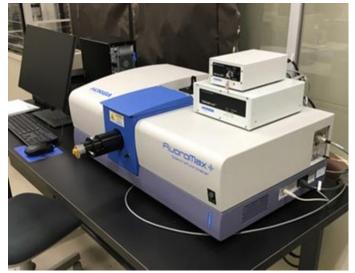
オスミウムコーター

◆評価装置



顕微ラマン分光装置

- 化学結合の情報
- 結晶・非結晶性の違い
- ・応力、ひずみの情報
- 分子構造の情報/ 結晶構造の違い
- レーザー波長:532nm、782nm
- ・講習会あり



蛍光りん光分光光度計

- 試料の同定・不純物の存在を推定
- 低濃度試料の濃度が測定
- 分子間相互作用の解明
- ・光源:オゾンレスキセノンランプ・燐光用フラッシュランプ
- 試料最大サイズ:~10 mm角程燐光寿命計測範囲:10 μs以上
- 発光波長計測範囲: 290~970 nm

▶評価装置



X線回折装置(XRD)

粉末サンプル、固体サンプル、 液体サンプルの相組成、結晶構造、配向などの物性を分析

- ・ 試料サイズ; 2インチ
- ・講習会あり



・材料の膜厚測定

- 仕事関数・イオン化ポテンシャル
- ・液体・粉末など物質の電子状態をそのまま解析
- エネルギー捜査範囲: 3.4~6.2 eV
- 最大試料サイズ: 50mm x 50mm、10mm t

大気中光電子分光装置(AC-2)

▶評価装置



原子間力顕微鏡(AFM)

- ・表面構造や組成
- 原子分解能で三次元の形状情報
- ・ 測定力が極めて小さいため、ほとんど非破壊で測定
- 測定モード:AFM/DFM/PM/FFM
- 最大試料サイズ: φ35mm/厚さ10mm



白色顕微鏡

非接触・非破壊の3次元表面形状・粗さ計測

◆予約なしで利用できる装置



クリーンドラフトチャンバー



デジタルマイクロスコープ : 高精細画像での観察、計測、記録



灰化装置 (Ashing)

- レジスト剥離
- ・ 試料を加熱・燃焼し無機化合物に
- 使用ガス;O2

◆VBLクーリンルームの前室のロッカー利用について



- 各研究室に配分
- ・パスワードを各研究室で決めて共用利用する しかし、薬品などは保管禁止
- 希望の研究室は、VBL教員室で使い方を教えてもらう

◆VBLクーリンルームの前室の洗濯機利用について



洗濯が終わったらすぐに回収!! 一週間くらい放置されている場合、 こちらで処分します。

◆各装置の利用に関して

- ■講習会を受けた方のみ利用可能な装置
 - ■SEM(走查型電子顕微鏡)S5200
 - ■レーザーリソブラフィ
 - ■顕微ラマン(RAMAN)
 - ■超高真空蒸着装置
 - ⇒個別に講習会の依頼を受け、行う
- ■その他、
 - ■ICP (Inductively Coupled Plasma)
 - ■SEM(電界放出型走查電子顕微鏡)S4300
 - ■RIE (Reactive Ion Etching)
 - ■X線回折装置 (XRD)
 - ■白色顕微鏡
 - ■大気中光電子分光装置(AC-2)
 - ⇒各研究室の利用者からオペトレを受け、利用可能
- ■DII装置とARIM装置は各自の担当に確認

装置予約に関する内容

- ホームページから装置予約して利用する
- ・利用時間を考えて予約しよう
- ・予約時間を守ろう
- ・利用料金は装置予約時間で課金される

VBLホームページ

(http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/)

東海国立大学機構 名古屋大学

ディープテック・シリアルイノベーションセンター ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー

高次機能ナノプロセス技術に関する研究





Facility



About us

Access



サイトにアクセスするにはサインインしてください

//www.vbl.nagoya-u.ac.jp では認証が必要となります トイトへの接続は安全ではありません

F-名 VD

5-F semicondhejiheji

サインイン

キャンセル



VBL装置予約ページ

※ 2022年1月 装置予約サイトをリニューアルしました



Equipment

Lecture

Go to VBL Equipment Reservation Page

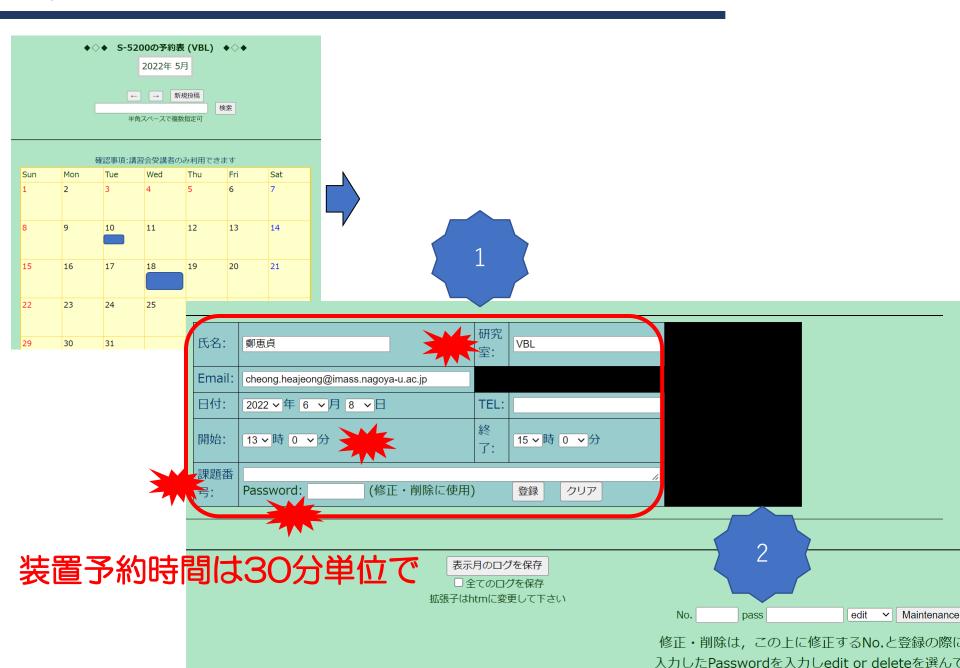
VBL装置予約ページへ

ここをクリックしてくだすい

予約にはIDパスワードが必要です

不明な場合は以下までご連絡ください 管理者:cheong.heajeong@imass.nagoya-u.ac.jp





[HOME]

◆◇◆ S-5200の予約表 (VBL) ◆◇◆

課題番号は省略できません!課題番号は必ず入力してください

不明な場合は<u>こちら</u>を確認してください

それでも不らか場合は、neong.heajeong@imass.nagoya-u.ac.jpまでご連絡ください

表示月のログを保存

□全てのログを保存

拡張子はhtmに変更して下さい



【ご案内】

- ■この課題番号リストは 4 月 15 日時点のリストです。 課題番号は定期的にアップデートします。
- ■ARIM の課題番号は次の様に省略して構いません。 JPMXP1222NUXXXX⇒22NUXXXX
- ■課題番号が不明な場合は責任者にご連絡ください。 課題番号リストに反映さ入れていない場合、NU0000 と入力してください。

■ARIM 課題番号

利用課題番号	利用者/ 研究室名	利用課題責任者名
JPMXP1222NU0201	Photo electron Soul	小泉 淳 典夫
JPMXP1222NU0202	(株) NANORUS恒雄	宇理須 恒雄
JPMXP1222NU0203	名市大/田上先生	田上 辰秋
JPMXP1222NU0204	イビデン(株)	東 広和
JPMXP1222NU0205	大豊工業株	林田 喜久治
JPMXP1222NU0206	株山一ハガネ	田島 秀春
JPMXP1222NU0207	ソニーGM & O	波江野 隼
JPMXP1222NU0208	奥村研	永島 壮
JPMXP1222NU0209	朝日インテック(株)	田川 智裕
JPMXP1222NU0210	松尾研	松尾豊
JPMXP1222NU0211	名工大/中村先生	中村 匡徳
JPMXP1222NU0212	スクリーンHD	谷出 敦
JPMXP1222NU0213	核融合科学研究所/田中先生	馮 双園
JPMXP1222NU0214	イオンテクノセンター	須山 篤志
JPMXP1222NU0215	則永研	Suchada Sirisomboonchai
JPMXP1222NU0216	高見研	髙見 誠一
IPMXP1222NI I0217	典田市研 / 点小堆	血山 政士

No. pass edit Maintenance

修正・削除は、この上に修正するNo.と登録の際に入力したPasswordを入力しedit or deleteを選んでntenanceボタンを押してください。

annecho Ver0.98 Created by Tacky's Room

[HOME]

◆◇◆ S-5200の予約表 (VBL) ◆◇◆

課題番号は省略できません!課題番号は必ず入力してください

不明な場合はこちらを確認してください

それでも不明な場合はcheong.heajeong@imass.nagoya-u.ac.jpまでご連絡ください

表示月のログを保存

□全てのログを保存

拡張子はhtmに変更して下さし

予約の時入力したパスワード を入れて予約の日程や時間、 除去などを行う



No. 0000 pass ····· edit ✓ Maintenance edit ✓ Maintenance edit / 修正・削除は,この上に修正す delete 登録の際に入力したPasswordを入力しedit or deleteを選んでMaintenanceボタンを押してください.

annecho Ver0.98 Created by Tacky's Room

パスワードを忘れた場合:

事務室で確認 内線:5447

E-mail; office@vbl.nagoya-u.ac.jp

★注意点

- S4300 (SEM) は装置利用時間が2時間まで
- その他装置は2週間先まで予約可能
- ・ラマンは1週間先まで予約可能

◆講習会うあ装置使用に関する問い合わせ

■VBL

- VBL Office : office@vbl.nagoya-u.ac.jp
- 斎藤:saito.kiyonori.z3@f.mail.nagoya-u.ac.jp
- 鄭: cheong.heajeong.p5@f.mail.nagoya-u.ac.jp
- 出来: deki@nagoya-u.jp

• 鄭: cheong.heajeong.p5@f.mail.nagoya-u.ac.jp

■黒川研

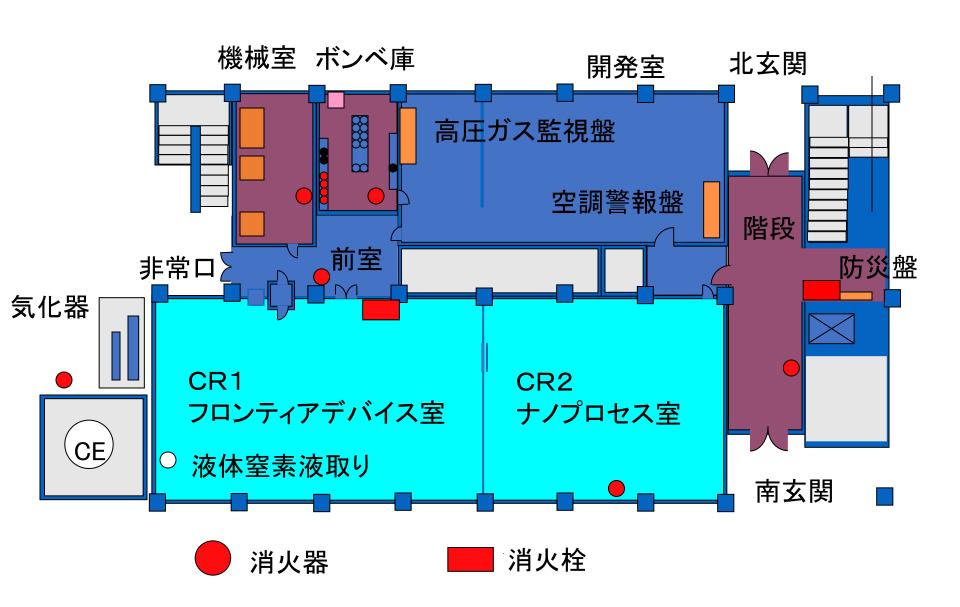
• 黒川: kurokawa.yasuyoshi@material.nagoya-u.ac.jp

■その他

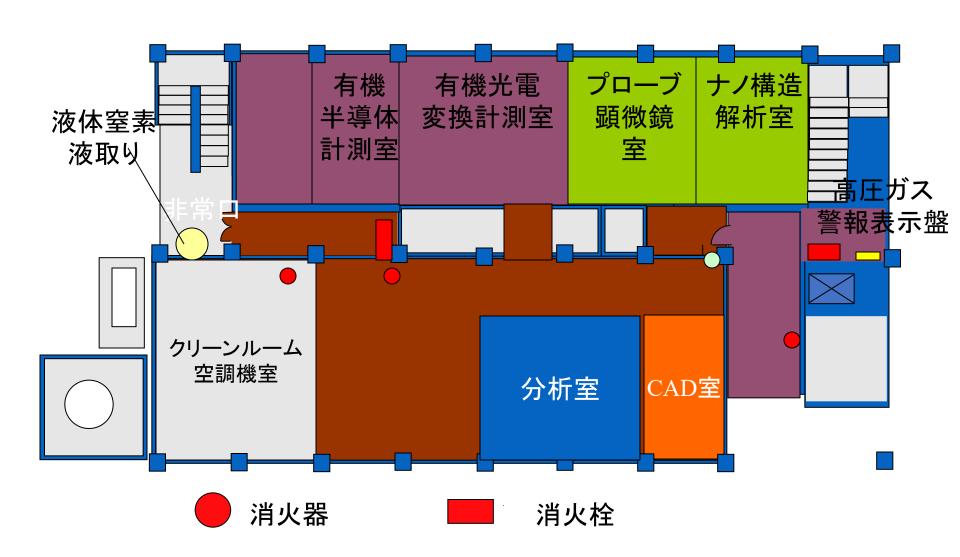
• CAD : deki@nagoya-u.jp

防災設備について

◆防火設備1階



◆防火設備2階





◆大学の防災連絡体制

名古屋大学緊急時対応マニュアル(目撃者・当事者等初期対応図)

火災、急病、事故、事件

- 動 大声で火災・急病を知らせ協力を求める
- ② 火災警報ベル押下(建物内)
- 3 消防署への通報

〈通報内容〉

事故等現場、状況、負傷者、通報者の氏名・電話番号 (火災ですか? 急病ですか?)

4 緊急時対応窓口への通報

〈通報内容〉

事故等現場、状況、負傷者、救急車要請又は要請済みの連絡、救急車等誘導依頼、通報者の氏名・電話番号

●作業・火元責任者等への通報

〈通報内容〉

事故等現場、状況、負傷者、救急車要請状況、通報者の氏名・電話番号

- ●上司・指導教員等への通報
- 初期対応 初期消火、応急処置、電源・ガス源切断等
- 6 身の危険を感じたら避難



◆大学の防災連絡体制

連絡先の確認!

110、119番通報したら守衛等の緊急連絡先にも必ず連絡を!

※連絡を受けた守衛は救急車、パトカー、消防車を現地へ誘導します。 119番通報後に守衛への連絡を行わなかったことで、守衛が現地に誘導できず、消防車の 現地到着が遅れた事案も発生しています。



キャンパス毎の緊急連絡先

東山 052-789-2111 本部守衛

鶴舞 052-744-2939 防災センター

大幸 052-719-1829 (夜間) 警務員室